JP 404000732 A JAN 1992

BEST AVAILABLE COPY

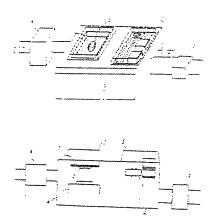
..4: WAFER PROBER

(11) 4-732 (A) (4.0 % 1.1 % 1.1 % 1.1 % 1.1 % (1.1 % 1

(51) Int. CF. H01L21 (66.G01R31 26)

PURPOSE: To enable prevention of oxidation of a probe card, prevention of temperature rise of DUT and removal of dust inside a wafer prober by providing a means to absorb from the outside, a means to shut a prober airtight from the air and filter to remove dust.

CONSTITUTION: After a transparent case 5 is opened and a wafer is provided to a wafer loader part 3, the transparent case 5 is closed and the wafer prober is shut off from outside air. Then, nitrogen gas is fed forcibly inside the wafer prober by a compressor 6 and evacuated through a filter 7. In the state, it is brought into contact with a probe card 2 and various tests are made. Since nitrogen gas is always fed through the filter i during operation of the wafer prober, oxygen is removed and oxidation of the probe card 2 is prevented. Furthermore, heat generation of DUT is prevented due to effects of air cooling. Since gas flows inside the wafer prober, it is possible to discharge dust generated inside to the outside and to remove it by the filter 7.



CM108664

BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-732

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)1月6日

H 01 L 21/66 G 01 R 31/26 B

7013-4M 8203-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

◎発明の名称

ウエハープローバ

②特 顯 平2-102050

②出 願 平2(1990)4月17日

@発明者 河 合

誠 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 増雄

外2名

明 紐 音

1. 発明の名称

ウェハーブローバ

2. 特許請求の範囲

ウェハー状の被試験素子を試験する為のウェ ハーブローバにおいて、外部から、ガスを吸入さ せるコンブレッサを設けた事と、本体を密閉した 事と、人とのインターフェース部分に開閉可能な 透明ケースを設け、密閉した事と、外部へガスを 排出する排気ダクトを設けた事と、ダクト中に フィルタを設けた事を特徴とするウェハーブロー

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明はウェハー状の被試験素子(Device Under Test、以下DUT という)を概述、試験するウェハーブローバに関するものである。

[従来の技術]

第3 図は従来のウェハーブローバの斜視図、 第4 図は第3 図に示す B・B における主要部分の断 面図を示す。

図において (1) は DUT を試験する為の電気回路を搭載した DUT ボード. (2) は DUT ボード (1) と DUT とを電気的に接続する為の ブローブカード、(3) は ウェハーをセッティングするカセットや、 搬送する ベルト から構成される ウェハーローダ 部、 (4) は ウェハーを載せて、移動する ウェハーステージである。

次に動作について説明する。ウェハーローダー部 (3) のカセットにセットされたウェハーはベルトにより搬送され、ウェハーステージ (4) に載せられる。その後、プローブカード (2) とウェハーステージ (4) を上昇させて、プローブカード (2) とり17 を接触させる。その後、DUT ボード (1) から、各種信号を与え各種試験を行なう。試験を了から、各種信号を与え各種試験を行なう。試験でプローステージ (4) が次のDUT と ブローブカード (2) が接触する様、移動する。 すべて のDUT の試験が終了した場合、ウェハーステージ (4) はウェハーローダ (3) まで移動し、現在

REST AVAILABLE COPY

特閒平4-732(2)

載っているウェハーをウェハーローダ郎(3) に 載せて、 カセットに戻す。 以上の 動作をすべてのウェハーに対して行なう。

これら一連の動作は現在すべて通常雰囲気中で行われている。

[発明が解決しようとする課題]

この発明は上記の様な問題点を解消する為になされたもので、 ブローブカードの酸化を防止でき

この発明に係るウェハープローバは、外部から ガスを吸入する手段と、ブローバを外気から密閉 する手段と粉塵を除去するフィルタを設けたもの である。

るとともに、DUT の温度上昇を防止し、さらに、

ウェハーブローバ内で発生する粉磨を除去できる

ウェハーブローバを得る事を目的とする。

[課題を解決するための手段]

「作用]

この発明においてはガスを吸入する手段により、外部より強制的にガス(例えば望素)を送り込み、ウェハープローバ内をガスが流れる事で、酸素、粉塵を除去し、DUTを冷却する。

[実施例]

以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1 図はウェハーブローバの斜視図、第2 図は第1 図に示すA・A における主要部分の断面図である。

図において、(1)~(4)は第3図及び第4図の従来例に示したものと同等であるので説明を省略す

る。(5) は人とのインターフェイス部分を密閉する為の透明ケース。(6) は外部からガスを吸入する為のフィルタ付のコンブレッサ。(7) はブローバから発生した粉塵を除去する為のフィルタ。(8) は外部へガスを排出する排気ダクトである。

 外部に排除し、フィルタ (7) によって取り除く事ができる。

[発明の効果]

以上の様に、この発明によればウェハーブローバを密閉し、外部から、フィルタを通したガスを強制的に吸入し、排気できる様にしたので、プローブカードの酸化防止、DUT の温度上昇の防止及び、ウェハーブローバ内の粉磨の除去が可能となり、信頼性の高い、安定した試験が可能となる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例によるウェハーブローバを示す 料視図、第2 図は第1 図に示す A・A における主要部分の断面図、第3 図は従来のウェハーブローバを示す斜視図、第4 図は第3 図に示す B・B における主要部分の断面図である。図において、(1) は DUT ボード、(2) は プローブカード、(3) は ウェハーローダ部、(4) は ウェハーステージ、(5) は 透明ケース、(6) は コンプレッサ、(7) はフィルタである。

BEST AVAILABLE COPY

特開平4-732 (**3)**

尚、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示

Ŧ.

代理人 大 岩 墹 雄

